

# Traitement par plasma froid de brulures et plaies infectées



## **CONTEXTE D'UTILISATION**

L'utilisation des plasmas froids à des fins thérapeutiques connait un engouement exceptionnel ces dernières années. Les plasmas froids peuvent être générés dans l'air, ou dans des gaz neutres, par des décharges électriques à haute tension et sans induire de courant continu (DBD). Il est connu que les espèces réactives produites dans ces plasmas froids ont un effet virucide et bactéricide ; cette propriété est utilisée dans les dispositifs de traitement d'air. Dans le cas présent, il a été démontré sur des modèles précliniques que le plasma froid permet d'accélérer la cicatrisation brûlures sévères.



#### **DESCRIPTION**

Le plasma froid est créé par une décharge électrique dans un flux d'hélium, et induit au contact de l'air ambiant des espèces chimiques réactives de l'oxygène et de l'azote, comme l'oxyde nitrique, connu pour favoriser la cicatrisation. La peau greffée après une brûlure, soumise à de faibles doses de plasma froid, cicatrise plus rapidement grâce à la stimulation de la croissance des cellules cutanées, une meilleure génération de nouveaux vaisseaux sanguins (angiogenèse). Dans le même temps, le plasma froid active le système immunitaire inné (les macrophages) pour détruire les agents infectieux, à l'origine des septicémies, principale cause de décès post-greffe.



#### **ATOUTS**

Accélération de la cicatrisation de greffe de peau.

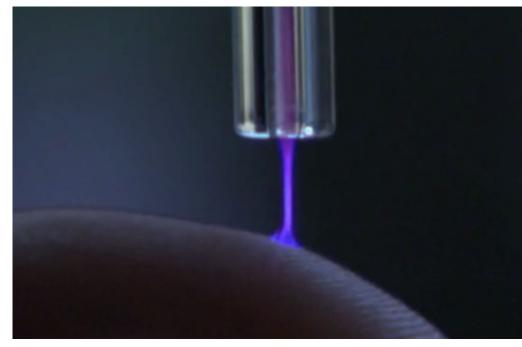
Traitement sans contact et non invasif. Diminution de la charge bactérienne dans les greffons traités par plasma.

Traitement parallèle de grande surface de peau par source plasma étendue.



#### PARTENARIAT POSSIBLE

Licence, option d'achat Contrat de collaboration Prestation de R&D



Le plasma froid est à température ambiante et il peut être mis au contact avec les tissus ambiants.



## **PROTECTION**

Dépôts de demandes de brevets E/C Savoir-faire lié à la conception de sources plasmas étendues, avec contrôle de doses d'exposition; dossiers de fabrication. Mandataire PI : Ecole polytechnique



# **EQUIPE DE RECHERCHE**

Laboratoire de Physique des Plasmas – UMR 7648, avec l'Institut Pasteur et le Service de Santé des Armées

Antoine Rousseau DR CNRS au LPP – LIMR

<u>Antoine Rousseau</u>, DR CNRS au LPP – UMR 7648

Avec le soutien partiel de l'AID, de la SATT Paris-Saclay et de l'IP Paris



# **CONTACTS**

cieds-contact@ip-paris.fr
nos offres

L'Institut polytechnique de Paris (<u>IP Paris</u>) regroupe l'Ecole polytechnique, l'ENSTA Paris, l'ENSAE, Télécom Paris et Télécom SudParis. Le <u>CIEDS</u> est soutenu par l'Agence de l'Innovation de Défense (<u>AID</u>).